≪연구논문≫ Journal of the Korean Magnetics Society 27(5), 175-179 (2017)

Angular Dependence of Exchange Stiffness Constant of NiFe Thin Film

Seok Soo Yoon and Dong Young Kim*

Department of Physics, Andong National University, Andong 36729, Korea

(Received 10 October 2017, Received in final form 19 October 2017, Accepted 19 October 2017)

The exchange stiffness constant A_{ex} was linearly propositional to the difference of spin wave resonance field H_{SWR} and ferromagnetic resonance field H_{FMR} . In this work, we measured the H_{SWR} and H_{FMR} with in-plane angles in order to analyze the angular dependence of A_{ex} in NiFe thin film with thickness of 100 nm. The A_{ex} of NiFe thin film was shown isotropic behavior not depending on the inplane angles. The measured value of A_{ex} was 10.9×10^{-7} erg/cm and its value should be applied to the spin wave devices. **Keywords :** thin film, ferromagnetic resonance, spin wave resonance, exchange stiffness constant, uniaxial anisotropy

NiFe 박막에서 교환 뻣뻣함 상수의 각도 의존성 분석

윤석수 · 김동영*

안동대학교 물리학과, 경북 안동시 경동로 1375, 36729

(2017년 10월 10일 받음, 2017년 10월 19일 최종수정본 받음, 2017년 10월 19일 게재확정)

교환 뻣뻣함 상수 A_{ex} 는 스핀파의 공명 자기장 H_{SWR} 과 강자성 공명 자기장 H_{FMR} 의 차에 선형적으로 비례한다. 본 연구에서는 두께가 100 nm인 NiFe 박막에서 A_{ex} 의 각도 의존성을 분석하기 위하여 수평면에서 자기장 각도에 따른 H_{SWR} 와 H_{FMR} 를 측정하였다. NiFe 박막의 A_{ex} 는 수평면의 자기장 각도와 무관하게 등방성 특성을 보였다. 본 연구에서 측정된 A_{ex} 의 값은 10.9 × 10⁻⁷ erg/cm였으며, 이 값은 스핀파를 이용한 소자에 응용될 수 있다.

주제어 : 박막, 강자성 공명, 스핀파 공명, 교환 뻣뻣함 상수, 일축 이방성

I.서 론

자성 재료를 이루는 원자 내부의 스펀들은 스핀스핀 사이 에 작용하는 강자성 결합에 의하여 스핀들이 모두 한쪽 방향 으로 정열 되며, 이러한 스핀들의 정열에 의하여 강자성이 나 타난다. 강자성 재료에 자기장을 인가하면 스핀들 각각은 자 기장 방향을 중심으로 세차 운동을 하게 되며, 세차운동을 하 고 있는 스핀들에 의하여 만들어진 파동을 스핀파(spin wave)라고 한다. 따라서 강자성체 매질을 진행하는 스핀파의 전파 특성은 스핀들의 진동을 매개하는 교환 뻣뻣함 상수 (exchange stiffness constant, *A*_{ex})에 의존한다. 이러한 교환 뻣뻣함 상수 *A*_{ex}는 스핀파를 이용한 스핀 소자 연구뿐만 아 니라 자구의 생성/소멸 및 자벽의 크기 분석에 이용된다[1, 2]. 또한 교환 뻣뻣함 상수(A_{ex})는 차세대 자기 메모리의 미디 어 재료로 부각되고 있는 연자성/경자성이 결합된 교환 스프 링 구조의 자화 특성 분석에 활용되고 있다[3]. 그러나, 교환 뻣뻣함 상수 A_{ex} 는 자성 재료의 성분[4] 및 제작 조건[5] 등 에 따라서 변화되는 특성이 있으며, 브릴루앙 빛산란[5], 중 성자 산란[7] 및 스핀파 공명[8] 등을 이용하여 측정되고 있 다. 이들 교환 뻣뻣함 상수 A_{ex} 의 특성 변화에 대한 연구는 미미하며, 본 연구에서는 스핀파 공명을 이용하여 교환 뻣뻣 함 상수 A_{ex} 의 각도 의존성을 분석하였다.

자성 박막에서 모든 자기 스핀들이 동일하게 세차 운동 (coherent precession) 하면서 공명 조건을 만족할 때 강자성 공명이라 부른다. 한편, 세차운동을 하는 자기 스핀들이 만드 는 스핀파가 박막 재료의 두께 방향으로 진행하면서 정상과 (standing wave) 조건을 만족할 때 스핀파 공명(spin wave resonance)이 발생되며, 두께가 560 nm인 NiFe 박막 재료에서 처음 발견되었다[9]. 강자성 공명(ferromagnetic resonance,

[©] The Korean Magnetics Society. All rights reserved. *Corresponding author: Tel: +82-54-820-5445, Fax: +82-54-823-1628, e-mail: dykim@andong.ac.kr

FMR) 장치를 이용하여 측정한 강자성 공명과 스핀파 공명은 LLG(Landau-Lifshitz-Gilbert) 운동 방정식을 사용하여 분석되 고 있다. 특정 주파수를 사용하는 FMR 장치를 이용하여 강 자성 공명 신호와 스핀파 공명 신호를 동시에 측정하면, 스 핀파 공명 신호는 강자성 공명 신호 보다 작은 자기장에서 나타난다. 교환 뻣뻣함 상수 A_{ex} 는 강자성 공명 자기장과 스 핀파 공명 자기장의 차에 선형적으로 비례하는 특성이 있다. 따라서 강자성 공명 자기장과 스핀파 공명 자기장를 동시에 측정하여 강자성 재료의 교환 뻣뻣함 상수 A_{ex} 를 구하는 방 법이 사용되고 있다.

따라서 본 연구에서는 두께가 100 nm인 NiFe 재료의 수평 면에서 자기장 각도에 따른 강자성 공명 신호와 스핀파 공명 신호를 측정하였으며, 이들 결과로부터 교환 뻣뻣함 상수 A_{ex} 의 각도 의존성을 분석하였다.

II. 실험 방법

강자성 재료인 NiFe 박막은 고진공 DC 마그네트론 스퍼터 링 방법을 사용하여 열산화막이 있는 Si 기판 위에 NigoFe20 타켓을 사용하여 100 nm의 두께로 증착 하였으며, 진공에서 적외선을 사용하여 250 ℃의 온도에서 3분 동안 열처리를 하 였다. NiFe 박막의 결정성 향상을 위하여 하부층으로 Ta(5 nm)/Cu(5 nm)를 증착 하였으며, NiFe 자성 박막의 표면 산 화를 방지하기 위하여 NiFe 상부에 Ta(5 nm)를 증착 하였다. 제작된 NiFe 박막의 적층 구조는 Si/SiO₂/Ta/Cu/NiFe(100 nm)/Ta이었으며, 증착된 NiFe 박막의 조성비는 79 wt% Ni와 21 wt% Fe였다. NiFe 박막 재료의 자기장 세기에 따른 강자 성 공명 신호 및 스핀파 공명 신호는 FMR 측정 장치인 Bruker사의 Xepr를 사용하였으며, 9.89 GHz(X-band)의 고정 주파수에서 측정하였다. NiFe 박막의 교환 뻣뻣함 상수 Aex 의 각도 의존성을 분석하기 위하여 수평면(in-plane)에서 자기 장 각도 61에 따른 강자성 및 스핀파 공명 신호를 동시에 측정하여 강자성 공명 자기장과 스핀파 공명 자기장을 각각 도출하였다. 또한 NiFe의 포화 자화량을 측정하기 위하여 수 직면(out-of-plane)에서 자기장 각도 04에 따른 강자성 공명 신호를 측정하였다.

III. 실험 결과 및 고찰

강자성 공명 신호는 강자성 재료의 결정이방성, 유도이방성, 다층박막의 층간 결합력 및 교환 바이어스 등을 이방성 특성 을 분석하기 위하여 이용되고 있다. 한편, 스핀파 공명 신호 는 교환 뻣뻣함 상수를 분석하는데 이용되고 있으며, 재료의 두께에 의존하는 스핀파 공명 자기장 *H_{SWR}*은 다음과 같이 표 현된다[10-13].

$$H_{SWR} = H_{FMR} - \frac{2A_{ex}}{M_s} \left(\frac{n\pi}{t}\right)^2 \tag{1}$$

여기서 H_{FMR}는 강자성 공명 자기장이고, t와 M₃는 박막의 두 께 및 포화 자화량이다. 자성 재료의 교환 뻣뻣함 상수 A_{ex}는 스핀파들의 탄성 특성을 나타내는 자성 재료의 물성이다. n은 스핀파의 정상파 모드를 나타내는 정수이다(n = 1, 2, 3, 4). 식(1)에서 스핀파 공명 자기장은 강자성 공명 자기장 보다 작은 자기장에서 나타나며, 강자성 공명 자기장과 스핀 파 공명 자기장의 차이는 박막의 두께의 제곱에 반비례하고, 교환 뻣뻣함 상수 A_{ex}와 자성 재료의 포화 자화량 M₃에 비례 한다. 따라서, 식(1)로부터 교환 뻣뻣함 상수 A_{ex}는 다음과 같 이 표현된다.

$$A_{ex} = (H_{FMR} - H_{SWR}) \frac{M_s t^2}{2\pi^2 n^2}$$
(2)

본 연구에서는 두께가 100 nm인 NiFe 박막의 교환 뻣뻣함 상수 A_{ex} 를 분석하기 위하여 자기장의 세기에 따른 공명 신 호를 측정하였다.

Fig. 1은 두께가 100 nm인 NiFe 재료의 자화 용이축 방향에서 자기장의 세기에 따라 측정한 공명 신호 특성을 보인것이다. 두께가 100 nm인 NiFe 재료는 두 개의 공명 신호가측정되었다. 자기장의 세기가 932 Oe에서 보인 공명 자기장은 강자성 공명 자기장 H_{FMR}에 해당하며, 강자성 공명 자기장 보다 낮은 685 Oe의 자기장에서 나타난 공명 자기장은 두께 방향으로 진행하는 스핀파의 정상파 공명에 기인하는 스핀파 공명 자기장 H_{SWR}이다. Fig. 1에서 측정된 스핀파는



Fig. 1. (Color online) Measured resonance signals with magnetic field at easy axis ($\phi_{H} = 0^{\circ}$) in NiFe thin films with thickness of 100 nm.



Fig. 2. (Color online) (a) Ferromagnetic resonance field H_{FMR} and (b) spin wave resonance field H_{SWR} with in plane magnetic field angle ϕ_{H} measured in NiFe thin film with thickness of 100 nm. The solid lines are fitted by Eq. (3).

n = 1에 해당하는 정상파 모드만 측정되었다. 따라서, 본 연구 에서는 n = 1에 해당하는 정상파 모드에 의한 교환 뻣뻣함 상 수 A_{ex}를 식(2)에 대입하여 구하였다. NiFe 박막의 교환 뻣뻣 함 상수 A_{ex}의 각도 의존성을 분석하기 위하여 수평면(inplane)에서 자기장 각도 ϕ_H 에 따른 강자성 및 스핀파 공명 자기장을 각각 측정하였다.

Fig. 2(a)와 (b)는 수평면에서 측정한 강자성 공명 자기장 H_{FMR} 및 스핀파 공명 자기장 H_{SWR}의 수평면 각도 의존성을 보인 것이다. NiFe은 이방성 자기장 H_K가 포화 자화량 보다 매우 작은 4πM_s ≫ H_{res} ≫ H_K 조건을 만족하므로 강자성 공명 자기장 H_{FMR}은 간단하게 다음과 같이 표현된다[14].

$$H_{FMR} = \left(\frac{\omega}{\gamma}\right)^2 \frac{1}{4\pi M_s} - H_K \cos 2\phi_H - H_C \cos 4\phi_H \tag{3}$$

여기서 γ=gμ_B/ħ는 자기 스핀의 자이로 계수(gyromagnetic factor)이며, g, μ_B, 및 ħ는 각각 g-factor, 보아 마그네톤 상 수 및 플랑크 상수이다. 또한 ω는 마이크로파의 각주파수



Fig. 3. (Color online) Ferromagnetic resonance field H_{FMR} with out-of plane magnetic field angle θ_H measured in NiFe thin films with thickness of 100 nm. The solid lines are fitted by Eq. (4).

(*ω* = 2*π*f)이며, *φ*_H는 박막 재료의 수평면에서 자화 용이축으 로부터 측정된 자기장의 각도를 나타낸다. Fig. 2(a)에서 실선 은 식(3)을 이용하여 각도에 따른 강자성 공명 자기장을 계 산한 결과이며, 계산 결과로부터 NiFe 박막 재료의 일축 이 방성 자기장 *H_K* = 6.0 Oe였으며, 쌍축 이방성 상수 *H_c* = 1.1 Oe였다. 한편, Fig. 2(b)에서 보인 각도에 따른 스핀파 공명 자기장은 강자성 공명 자기장 보다 낮은 자기장 쪽으로 이동 되어 있었으며, 강자성 공명 자기장과 동일한 이방성 특성을 보임을 알 수 있었다. 식(2)에서 교환 뻣뻣함 상수 *A_{ex}*는 자 성 재료의 포화 자화량에 비례하는 특성이 있다. 따라서 본 연구에서는 NiFe 박막의 포화 자화량 *M*,를 도출하기 위하여 수직면에서 자기장의 각도에 다른 강자성 공명 자기장을 측 정하였다.

Fig. 3은 NiFe 박막에서 수직면의 자기장 각도에 따른 강 자성 공명 자기장을 보인 것이다. Fig. 3에서 실선은 수직면 자기장 방향(θ_H)에 대한 강자성 공명 자기장 H_{FMR}을 계산하 는 다음의 식(4)를 사용하였다[15, 16].

$$\left(\frac{\theta}{\gamma}\right)^{2} = (H_{res}\cos(\theta_{H} - \theta_{M}) - 4\pi M_{eff}\cos^{2}\theta_{M}) \times$$

$$(H_{res}\cos(\theta_{H} - \theta_{M}) - 4\pi M_{eff}\cos^{2}\theta_{M})$$

$$(4)$$

여기서 M_{eff} 는 유효 포화 자화량이고, θ_M 는 수직면에서 지구 의 자화 방향이다.

식(4)의 계산 결과로부터 두께가 100 nm인 NiFe 재료의 g=2.11과 M_{eff} =866.9 emu/cm²의 값을 각각 얻었다. M_{eff} 는 NiFe의 일축 이방성 상수 K_u 와 표면 이방성 상수 K_s 에 기인 하며 다음과 같이 표현된다.

$$M_{eff} = M_s + \frac{K_s}{2\pi M_s t} + \frac{K_u}{2\pi M_s}$$
(5)



Fig. 4. (Color online) (a) Angular dependence of exchange stiffness constant A_{ex} measured in NiFe thin films with thickness of 100 nm.

NiFe 박막의 일축 이방성 자기장($H_{Ku} = 2K_u/M_s$)은 약 5.7 Oe 로 매우 작으며, 두께가 100 nm인 경우 표면 이방성 상수에 의한 $2K_s/tM_s$ 도 매우 작다. 따라서 식(5)의 오른쪽 두 번째 및 세 번째 항을 무시하면 M_{eff} 는 M_s 로 근사하는 것이 가능 하다. 따라서 본 연구에서는 NiFe 박막의 포화 자화량 $M_s =$ 866.9 emu/cm²의 값을 식(2) 대입하여 교환 뻣뻣함 상수 A_{ex} 를 구하였다.

Fig. 4는 NiFe 박막의 교환 뻣뻣함 상수 A_{ex} 의 수평면 각 도 의존성을 보인 것이다. A_{ex} 는 수평면에서 자기장 각도에 따라서 일정한 값인 $A_{ex} = 10.9 \times 10^{-7}$ erg/cm을 나타내고 있 으며, 수평면에서 등방성 특성을 갖고 있음을 알 수 있었다. 이러한 등방성 특성은 Fig. 4에 삽입한 그림에서 보인 것과 같이 수평면 각도에 따른 ($H_{FMR} - H_{SWR}$)의 등방성 특성을 반 영하고 있음을 알 수 있었다. 본 연구에서 얻은 NiFe의 교환 뻣뻣함 상수 A_{ex} 의 타당성을 분석하기 위하여 다른 논문에서 제시한 계산 및 측정값을 비교한 결과를 Fig. 5에 나타내었다.

Fig. 5에서 보인 것과 같이 계산에 의한 Ni, Fe, Co 및 NiFe의 교환 뻣뻣함 상수 A_{ex} 는 각각 9.7, 20.1, 30.0, 13.0×10^{-7} erg/cm이었다[17]. 그러나 상온, 300, 400 °C의 온도에서 열처리한 NiFe 박막의 교환 뻣뻣함 상수 A_{ex} 는 각각 7.2, 10.7 및 12.9×10^{-7} erg/cm의 값을 나타내고 있었다[5]. 이렇듯 교환 뻣뻣한 상수 A_{ex} 는 재료의 구조, 조성 및 재료의 제작 조건에 따라서 변한다. 본 연구에서 측정한 250 °C에서 열처리한 100 nm 두께의 NiFe 재료의 교환 뻣뻣함 상수 $A_{ex} = 10.9 \times 10^{-7}$ erg/cm의 값은 Wei 등[5]이 300 °C에서 열 처리한 NiFe 재료에서 측정한 교환 뻣뻣함 상수 $A_{ex} = 10.7 \times 10^{-7}$ erg/cm의 값과 유사하게 나타났다. 따라서 본 연 구에서 얻은 NiFe 박막의 교환 뻣뻣함 상수 A_{ex} 는 타당한 값이며, 이 값은 스핀파를 이용한 스핀파 소자 연구, 자구의



Fig. 5. (Color online) (a) Composition dependence of exchange stiffness constant A_{ex} . The red star symbol shows present work. The black diamond symbols are measured values at different temperature [5] and blue circle symbols are calculated values [17].

생성/소멸 및 자벽의 크기 분석 등에 이용될 수 있다. Fig. 5에서 보인 Ni, Fe 및 Co 박막에 대한 교환 뻣뻣함 상수 *A_{ex}는 추후 측정을 통하여 계산 값과* 비교 분석할 예정이다.

IV. 결 론

본 연구에서는 스핀파의 공명 자기장 H_{SWR}과 강자성 공명 자기장 H_{FMR}의 차에 선형적으로 비례하고 포화 자화량에 반 비례하는 교환 뻣뻣함 상수 A_{ex}의 각도 의존성 분석하기 위 하여 두께가 100 nm인 NiFe 박막의 수평면에서 자기장 각도 에 따른 H_{SWR}와 H_{FMR}를 측정하였다. 또한 NiFe 박막의 포 화 자화량을 측정하기 위하여 수직면(out-of-plane)에서 자기 장 각도에 따른 강자성 공명 자기장을 측정하였으며, 계산 결 과로부터 두께가 100 nm인 NiFe 박막 재료의 포화 자화량 M_s = 866.9 emu/cm²의 값을 얻었다.

본 연구에서는 250 ℃에서 열처리한 100 nm 두께의 NiFe 박막 재료에서 측정한 (*H_{SWR} – H_{FMR}*)와 *M_s* 값을 사용하여 NiFe 박막의 교환 뻣뻣함 상수 *A_{ex}*를 구하였다. NiFe 박막 재료의 교환 뻣뻣함 상수 *A_{ex}*는 수평면의 자기장 각도와 무 관하게 등방성 특성을 보였으며, 등방성 특성을 보인 교환 뻣 뻣함 상수 *A_{ex}* = 10.9 × 10⁻⁷ erg/cm의 값을 얻었다. 본 연구 에서 사용한 250 ℃에서 열처리한 NiFe 재료의 교환 뻣뻣함 상수 *A_{ex}*의 값은 Wei 등[5]이 300 ℃에서 열처리한 NiFe 재 료에서 측정한 교환 뻣뻣함 상수 *A_{ex}* = 10.7 × 10⁻⁷ erg/cm의 값과 유사하게 나타났다. 따라서 본 연구에서 스핀파를 사용 하여 구한 교환 뻣뻣함 상수 *A_{ex}* = 10.9 × 10⁻⁷ erg/cm는 타 당한 값이며, 이 값은 스핀파를 이용한 스핀파 소자 연구, 자 구의 생성/소멸 및 자벽의 크기 분석 등에 이용될 수 있다.

감사의 글

본 연구는 미래창조과학부에서 지원하는 DGIST 일반사업 에 의해 수행되었습니다(17-BT-02).

References

- N. Vukadinovic, O. Vacus, M. Labrune, O. Acher, and D. Pain, Phys. Rev. Lett. 85, 2817 (2000).
- [2] N. Vukadinovic, M. Labrune, J. Ben Youssef, A. Marty, J. C. Toussaint, and H. Le Gall, Phys. Rev. B 65, 054403 (2001).
- [3] S. S. P. Parkin, M. Hayashi, and L. Thomas, Science 11, 190 (2008).
- [4] X. Liu, R. Sooryakumar, C. J. Gutierrez, and G. A. Prinz, J. Appl. Phys. 75, 7021 (1994).
- [5] J. Wei, Z. Zhu, C. Song, H. Feng, P. Jing, X. Wang, Q. Liu, and J. Wang, J. Phys. D: Appl. Phys. 49, 265002 (2016).
- [6] S. Vernon, S. Lindsay, and M. B. Stearns, Phys. Rev. B 29, 4439 (1984).
- [7] G. Shirane, V. J. Minkiewicz, and R. Nathans, J. Appl. Phys.

39, 383 (1968).

- [8] M. Belmeguenai, D. Apalkov, Y. Roussigné, M. Chérif, A. Stashkevich, G. Feng, and X. Tang, J. Phys. D: Appl. Phys. 50, 415003 (2017).
- [9] M. H. Seavey, Jr. and P. E. Tannenwald, Phys, Rev. Lett. 1, 168 (1958).
- [10] C. Bilzer, T. Devolder, J.-V. Kim, G. Counil, and C. Chappert, J. Appl. Phys. **100**, 053903 (2006).
- [11] K. Kiseki, S. Yakata, and T. Kimura, Appl. Phys. Lett. 101, 212404 (2012).
- [12] X. Liu, Y. Y. Zhou, and J. K. Fuedyna, Phys. Rev. B 75, 195220 (2007).
- [13] Y. Y. Kim, J. S. Baek, S. J. Lee, K. W. Rhie, and W. Y. Lim, J. Kor. Phys. Soc. 31, 495 (1997).
- [14] S. Yuan, K. Yu, L. M. Yu, S. X. Cao, C. Jing, and J. C. Zhang, J. Appl. Phys. 101, 113915 (2007).
- [15] S. Misukami, Y. Ando, and T. Miyazaki, Jpn. J. Appl. Phys. 40, 580 (2001).
- [16] S. Yuan, L. Wang, R. Shan, and S. M. Zhou, Appl. Phys. A 79, 701 (2004).
- [17] C.Y. You, Appl. Phys. Exp. 5, 103001 (2012).